

**NX-B100/B200**整片基板纳米压印系统经过了大量的实时实地验证，质量可靠，性能优越稳定。具备全部压印模式：热固化、紫外固化和压印。基于独特专利保护的Nanonex气垫软压技术（ACP），不论模版或基板背面粗糙程度如何，或是模版或基板表面波浪和弧形结构，NX-B100/B200均可对其校正补偿从而获得无与伦比的压印均匀性，ACP消除了基板与模版之间侧向偏移，有效地延长了模版使用寿命。通过微小热容设计可获得快速的热压印周期，最终得到快速的工艺循环。

### 主要特点

#### 所有形式的纳米压印

- 热塑化
- 紫外固化 (NX-B200)
- 热压与紫外压印同时进行 (NX-B200)
- 热固化

#### 气垫软压技术(ACP)

- Nanonex专利技术
- 完美的整片基板纳米压印均匀性
- 高通量

#### 低于10nm分辨率

快速工艺循环时间（小于60秒）

#### 灵活性

- 最大75毫米直径压印面积
- 各种尺寸及不规则形状模版与基板均可压印
- 方便用户操作

基于超过12年、15代产品开发经验的自动化压印操作

Nanonex压印系统经过大量实时实地验证，质量可靠，性能优越稳定

全自动纳米压印



**NX-B100/B200 多功能整片基板纳米压印系统**

### 纳米压印系统参数

#### 热塑压印模块 (NX-B100/B200)

- 温度范围0~250°C
- 加热速度>200°C/分钟
- 制冷速度>60°C/分钟
- 压力范围0 ~ 3.45 MPa (500 psi)

#### 紫外固化模块 (NX-B200)

- 58mW/cm<sup>2</sup>紫外LED光源
- 365纳米或395纳米波长可选
- 全自动化控制

#### 模版装载功能

- 最大3"模版可用于标配纳米压印系统

#### 基板装载

- 标配纳米压印系统可装载3"基板
- 各种尺寸及不规则形状模版与基板均可压印
- 独特专利保护ACP技术可最大限度保护模版和基板，特别对于象磷化铟 (InP) 等极易碎模版和基板给予最大限度。

### 其他参数

配有微软Windows的电脑控制系统  
用户友好的控制软件

程序化控制压印温度、压力和时间  
真空和压缩空气操作由电脑控制  
手动装载/拆卸基板

自动化压印操作  
设备占地面积：32" × 34"  
(810 mm × 860 mm)

应用领域：纳米电子和光电子、显示器、数据存储介质、先进材料、生物科技、纳米流道等